

动态配气探针测试系统

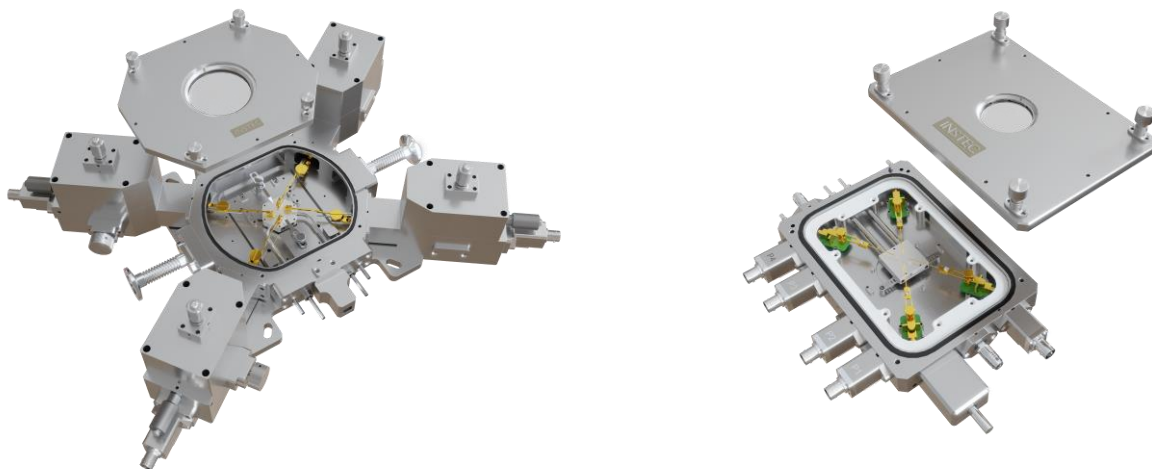
INSTECH 动态配气探针测试系统，由高精温控探针台、多组分动态配气组件两部分组成，适用于气敏器件，变温情况下的研究。温控探针台为待测器件提供变温环境、点针平台、气氛环境腔室，连接于动态配气组件，多组分配气可选，为腔室提供所需的气氛环境。

一、温控探针台

HCP421V-MPS 以及 HCP621G-PM 两款专为“INSTECH 动态配气探针测试系统”设计。HCP421V-MPS 可从外部移动探针进行精准点针操作；HCP621G-PM 为 mini 款，手动调节点阵位置，体积更小。

两款探针台上盖与底壳构成一个可抽真空的密封腔，亦可内充入所需气体。集样品温控、探针电测试、外部光学观察、腔室气氛环境控制为一体，外置电学 BNC 接口，为材料器件电学测试提供便捷精准的解决方案。

- 温度范围：-190℃ ~600℃
- 温度分辨率：0.01℃
- 温度稳定性：±0.1℃
- 传感器/温控方式：100Ω 铂 RTD / LVDC-PID 控制
- 最大制冷/加热速度：30℃/min
- 最小制冷/加热速度：±0.01℃/min
- 加热块材质：银
- 样品区域面积：φ30mm
- 上盖窗片观察：窗片范围 φ18mm，最大视角±58°
- 样品腔外部样品移动尺：粗调模式+微调模式，XY 粗调 20mm，XY 微调行程 10mm,Z 微调 3mm
- 调节精度：10um
- 真空腔，也可通入保护气
- 铼钨材质的弯针探针
- 探针接口：BNC 接头/三同轴 BNC 接头
- 台面电位：电接地/电悬空
- 含负温下窗口除霜管路



INSTEK 动态配气探针测试系统

二、全自动动态配气

INS-DX 全自动配气系统能对气瓶中的高浓度气体进行大比例稀释混合。根据气体方程式，仪器可自动计算配比浓度，易于溯源至国家标准。采用国际上通用的质量流量混合配气法，整个系统气路均采用防腐防吸附内表面抛光处理的不锈钢管或者聚四氟乙烯管，多通道可选（INS-D2~INS-D12，2~12 通道）。

- 气体质量流量控制器
- Air/N2 Range: 0~30000ml/min
- 样气 Range: 0~200ml/min
- 精确度: ±1%
- 密封: Viton(耐高温氟素橡胶)
- 响应时间: 1-2seconds
- 重复性: < ±0.2% Rd
- 量程比: 1:50 (数字模式为: 1:187.5)
- 泄漏率: tested < 2 x 10⁻⁹ mbar l/s He
- 电源: +15~24VDC@320mA
- 压力灵敏度: 0,1% Rd/bar typical N2;
0,01% Rd/bar typical H2
- 输出: 4~20mA and RS-232
- 选配: 不锈钢减压阀
铜镀铬减压阀
钢瓶气体
零气发生器
铝箔气袋
特氟龙气袋
快速接头



气体类型代码表											
Esc											
001	Air	011	NH3	021	C4H10	031	C2H4	041	CH3CL	051	C2HCL3
002	Ar	012	NO	022	CS2	032	F2	042	Br2	052	CH2CHCL
003	He	013	NO2	023	CCL4	033	C6H14	043	CH3SH	053	Xe
004	N2	014	O2	024	CF4	034	H2	044	Ne	054	C6H6
005	CH4	015	Ozone	025	C2N2	035	HB _r	045	C5H12	055	C7H8
006	CL2	016	SO2	026	C3H5	036	HCN	046	C3H8	056	C8H10
007	CO	017	C2H2	027	D2	037	HF	047	C3H6	057	CH(CH3)3
008	CO2	018	C3H4	028	B2H6	038	HI	048	SF6	058	NULL1
009	H2S	019	C4H6	029	C2H6	039	Kr	049	CF3CH2F	059	NULL2
010	HCL	020	C4H8	030	C2H6O	040	CH3	050	SiHCL3	060	NULL3

配气数据库气体种类